

FIB技術講習のご案内

FEI Versa 3D DualBeam

FEI Quanta 3D DualBeam



- ・ 断面出し加工
- ・ TEM試料作製
- ・ シリアルセクションニング法によるSEM像取得と3D再構築
- ・ SEM観察・EDS分析

参加1名より随時開催

参加料金：13,200円/0.5日、23,100円/1日
(装置使用料免除、支援料相当)

内容やお申し込み方法の詳細はこちらをご覧ください

URL: <https://arim.imr.tohoku.ac.jp>

Mail: imr.arim.office@grp.tohoku.ac.jp